

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛОТ №1

№	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Оборудование для ионной очистки и травления, для использования в технологиях атомно-слоевого осаждения (ALD)	Оборудование для ионной очистки и травления, предназначенное для использования в технологиях атомно-слоевого осаждения (ALD) LAD6, представляет собой специализированные установки, которые обеспечивают высокоточное удаление загрязнений с поверхности перед нанесением тонких пленок. - <i>Тип обработки:</i> ионная очистка и травление поверхности для подготовки пластин перед ALD. - <i>Энергия ионов:</i> диапазон энергии ионов регулируется от 50 до 1500 эВ, в зависимости от требований процесса травления и типа подложки. - <i>Макс. температура обработки:</i> до 300°C. - <i>Тип источника ионов:</i> источник инертных газов (аргон) для очистки и травления поверхности. - <i>Травление:</i> контролируемое ионное травление для удаления загрязнений и улучшения адгезии покрытия. - <i>Рабочее давление:</i> поддержание давления в камере на уровне 10^{-4}–10^{-6} Торр с точностью $\pm 1\%$ для обеспечения стабильности процесса. - <i>Система подачи энергии:</i> высокоточная система управления плазмой с возможностью регулирования энергии иона. - <i>Размер обрабатываемых пластин:</i> до 6 дюймов, соответствие требованиям ALD LAD6.	шт	1

Руководитель проекта №353/2024



Ж. Сағдолдина